AG

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-050404

(43) Date of publication of application: 24.03.1983

(51)Int.CI.

G01B 7/02

(21)Application number: 56-147945

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

21.09.1981 (72)Ir

(72)Inventor: MIYAZAKI KOICHI

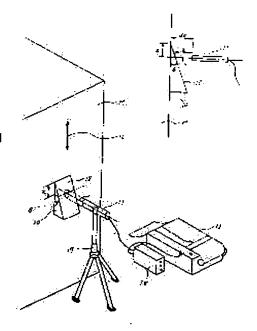
NO AKIHIKO

(54) DEVICE FOR MEASURING MINUTE DISPLACEMENT

(57)Abstract: PURPOSE: To measure

PURPOSE: To measure the minute displacement readily, by fixing a wedge shaped magnetic member to a material to be measured, and detecting the displacement of the inclined surface of said member.

CONSTITUTION: A wedge shaped detecting body 10 which comprises a magnetic member having constant permeability and has a vertical angle θ is fixed to the material to be measured M as a unitary body. The slant direction of the inclined surface 15 of the detecting body 10 is aligned with the vibrating direction of the material to be measured M. A detecting head 11, which detects the variation in electromagnetic energy due to a magnetic body, such as a magnetic sensor and an overcurrent detector is provided in front of the inclined surface 15. Since a distance (d) between the detecting head and the detecting body is changed in response to the vibrating displacement (x) of the material to be measured, the detected output also changes. The result is displayed on an pen recorder 12.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(JP) 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58-50404

⑤Int. Cl.³G 01 B 7/02

識別記号

庁内整理番号 7355-2F **43公開** 昭和58年(1983) 3 月24日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

90微小変位測定装置

②特

願 昭56—147945

@出

願 昭56(1981)9月21日

⑩発 明 者 宮崎耕一

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社生産技術研究所 内 ⑫発 明 者 能明彦

川崎市幸区小向東芝町1東京芝浦電気株式会社生産技術研究所

内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

\$11 h

川崎市幸区堀川町72番地

仍代 理 人 弁理士 則近憲佑

外1名

明 細 奮

1. 発明の名称

微小変位測定装置

2. 特許請求の範囲

傾斜角一定の傾斜面を有する楔形磁性部材からなり、変位する被測定物に対してその変位方向が上記傾斜面の傾斜方向になる如く一体的に固定された検出体と、上記被測定物に固定された検出体の傾斜面に対向し、上記被測定物の変位に基づくと記傾斜面までの距離変化を観磁エネルギの変化から測定する検出ヘットと、この検出ヘットの出力を表示する数示装置とを具備することを特徴とする微小変位測定装置。

3. 発明の詳細な説明

この発明は振動している物体などの微小変位を 御定する微小変位測定装置に関する。

物体の微小変位を測定する方法として従来より つきの方法が知られている。

(1) りず電流を発生する検出ヘッドを被測定物に対峙し、上記りず電流による電磁エネルギの欠損から検出ヘッドと被測定物との距離に比例した電

圧を発生させ、との電圧からその距離を測定する 方法。

(2)被測定物に光を投射し、その反射をフォトセンサで受光して反射光の強さに比例した難圧を発生させ、この難圧から検出ヘッドと被測定物との距離を測定する方法。

(3)コリメータを応用した方法。

しかし、これら方法のうち(1)かよび(2)は、第1 A 図に示すように被測定物(1)が検出ヘッド(2)の軸線または光軸に対して垂直な一方向(矢印(3a)方向)に移動する場合、および第2 A 図に示すように検出ヘッド(2)の軸線または光軸に平行を方向(矢印(3b)方向)に扱動する場合には、それぞれの1 B 図、第2 B 図に示すその出力世圧のチャート(4)から被測定物のでなたとができる。しかし、第3 A 図に示すように被測定物(1)が使いし、のいりに扱動している場合には、第3 B 図に切りに対してありに扱動に対してあるように扱動に対する信号が得られず、被測定物(1)の変位を初定

することができない。一方、コリメータを応用した方法は、 望遠鏡の光軸に垂直な 被御定物の変位を離れたところから 測定することができるが、 人間の眼で変位を読みとるため、 自動的、 連続的に 測定することができない。また、これを自動化すると、 装置が大型化し高価額になる欠点がある。

この発明は上記問題点を解決するため、傾斜角一定の傾斜面を有する磁性部材からなる楔形検出体を、その傾斜面の傾斜方向が被側定物の変位方向になる如く一体的に固定し、この検出体の傾斜面に検出ヘッドを対面させて、検出ヘッドから上記検出体の傾斜面までの距離変化に基づく 覚磁エネルギの変化から上記被測定物の変化を測定するものである。

以下、図面を参照し、この発明を一実施例に基づいて説明する。

第4図に示すように測定装置は楔形状をした検 出体(U)、その前面に設置された検出ヘッド(U)をよびこの検出ヘッドの出力を表示する表示装置(Q)から構成される。

(3)

(M)の振動変位×に対して、検出ヘッド(II)と検出体 (II)との距離はは次式のように一定の関係で変化し、 振動変位×が微小量などき、dと×は直線関係に ある。

 $d = d_0 - x \tan \theta$

ただしdo: 検出体頂点における検出ヘッドまでの 距離

そして、検出ヘッド(II)はこの検出ヘッド(II)と検 出体間との距離すにほぼ比例した電磁エネルギ変 化に基づく出力を送出するから、この出力をベン レコーダなどで配録すれば、その記録チャートか ら被測定物Mの振動などの数小変位を測定するこ とができる。

すなわち、従来の敬小変位測定装値では、 被側定物が検出ヘッドの軸線(または光軸)に対して 垂直方向に往復運動している場合、 その磁小変位 を測定することができなかったが、前述のように 楔形磁性部材からなる検出体を被測定物に一体的 に固定し、この検出体の傾斜面に磁気センサなど を内蔵する検出ヘッドを対面すれば、その電磁エ

上述のよりに傾斜角一定の傾斜面をもつ楔形磁性部材からなる検出体(0)をその傾斜面の傾斜方向が振動方向と一致する如く破御定物(M)に取付け、これに電磁エネルギの変化を検出する検出ヘッド(1)を対面させると、第5図に示すよりに被測定物

(4

ネルギの変化に基づく出力変化から、上記従来技術では不可能であった微小変位を容易に測定する ことができる また、その測定を連続的に測定す ることができ、低価額の自動化測定装置にするこ とも容易である。

4. 図面の簡単な説明

第1図(A)(B)図ないし第3図(A)(B)図はそれぞれ従来の変位測定方法の説明図、第4図はこの発明の一実施例図、第5図はその測定方法説明図である。

印:検出体、 印:検出ヘッド、

(M):被測定物。

代坦人 弁理士 則 近 **数** 佑 (ほか1名)

特開昭58- 50404 (3)

